CKD

出展のご案内

semi™ | SEMICON® JAPAN 50 YEARS

開催日 12/9(水)～11(金)　**時間** 10:00～17:00

場所 東京ビッグサイト　**CKDブース** 東2ホール　E2821

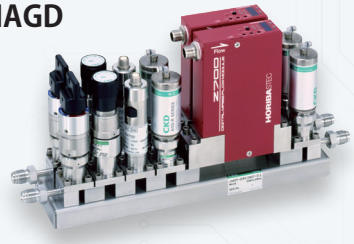
半導体製造工程に貢献するファインシステム機器

GAS control

Gas-Facilities　Gas-Vacuum process

Gas Supply　Deposition　Ion Implantation　Etching

集積化ガス供給システム
IAGD



エアオペレイトバルブ
AGD(高温・高耐久)



流量診断ユニット
TPB



レギュレータ
PGM



VACUUM control

真空圧力制御システム
IAVB





エアオペレイトバルブ
AVB



比例制御システム
VEC-R

CHEMICAL control

Chemical-Facilities　Chemical process

Chemical Supply　Cleaning　Resist Coating　CMP

エアオペレイトバルブ
AMD※※3R





エアオペレイトバルブ
(マニホールド)
GAMD※※3R



マニュアルバルブ
MMD※03RN

エアオペレイトバルブ
(ボルトレス)
AMD※1M





電動流量調整バルブ
MNV



パイロット式レギュレータ
PMP



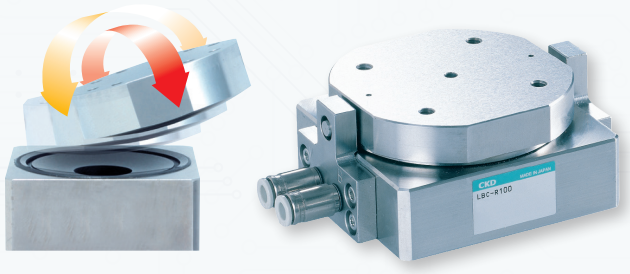
ファインレベルスイッチ
KML

半導体前工程から後工程まで貢献する機器と装置

ボンディング

エアジャイロ LBC-Rシリーズ

“倣い”で一発平行調整



実装

ファインバッファ FBU2シリーズ

磁石を利用したソフトな接触と
安定した押し圧を実現

アクティブファインバッファ AFB-RBシリーズ

モータとファインバッファを一体化



ウェハ表裏検査

薄型大中空DDモータ RDシリーズ

高精度DDモータ

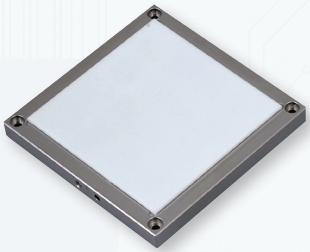
NIKKI DENSO
CKD日機電装株式会社



ハンドリング、搬送

精密吸着プレート PVPシリーズ

多孔質を利用した全面吸着で
ワークの歪み、変形を解消

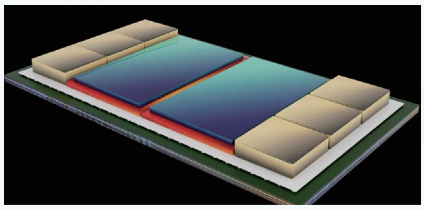


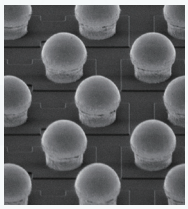
検査

高速三次元検査装置

【測定例】
マイクロバンプ高さ、Cuピラー、
ウェハー・基板の歪み、異物

測定例





- マイクロバンプ高さ
- Cuピラー
- ウエハー、基板の歪み
- 異物

検査

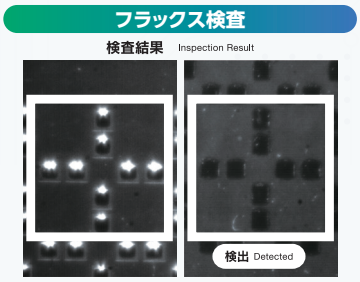
はんだ印刷検査機 VP9000Mシリーズ

微細はんだの3D高速高精度検査



新しい透明体検査技術

【測定例】
フラックス検査、TGV検査



半導体前工程から後工程まで、CKDのトータル技術力で
皆様の課題解決のヒントが見つかりますので、
お気軽にブースへお立ち寄りください。



YouTube

Instagram
@CKDCORPORATION

CKD株式会社 機器事業本部 販売促進部
〒485-8551 愛知県小牧市応時二丁目250番地
https://www.ckd.co.jp/ TEL: 0568-74-1304